

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4871937号
(P4871937)

(45) 発行日 平成24年2月8日(2012.2.8)

(24) 登録日 平成23年11月25日(2011.11.25)

(51) Int. Cl. F 1
A 6 1 H 33/12 (2006.01) A 6 1 H 33/12 A
A 6 1 H 33/02 (2006.01) A 6 1 H 33/02 A

請求項の数 5 (全 12 頁)

<p>(21) 出願番号 特願2008-255137 (P2008-255137)</p> <p>(22) 出願日 平成20年8月31日 (2008.8.31)</p> <p>(65) 公開番号 特開2010-51774 (P2010-51774A)</p> <p>(43) 公開日 平成22年3月11日 (2010.3.11)</p> <p>審査請求日 平成22年2月25日 (2010.2.25)</p> <p>早期審査対象出願</p> <p>前置審査</p>	<p>(73) 特許権者 504118276 株式会社遊気創健美倶楽部 大阪府東大阪市川俣一丁目1番41号</p> <p>(74) 代理人 100075557 弁理士 西教 圭一郎</p> <p>(72) 発明者 福田 加代美 大阪府東大阪市川俣1丁目1番41号 株式会社遊気創健美倶楽部内</p> <p>審査官 長谷川 一郎</p>
--	---

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 美顔器

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

所定量の化粧水をカップ29に収納し、且つ炭酸ガス供給用ポンベBから可撓性ホースPを介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体Sの先端噴出ノズル31から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に、炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に於いて、

(a) ソケット部5のネジ孔6に炭酸ガス供給用ポンベBの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4が、炭酸ガス供給用ポンベBを取替え可能に、捻じ込まれるソケット部5と

(b) 炭酸ガス供給用ポンベBの上端噴出口頭部3の上部に対峙するようにソケット部5に設けられ、噴出用管11、内孔12、ノズル孔13を備えるノズル部10であって、噴出用管11は炭酸ガス供給用ポンベBをソケット部5に捻じ込んだ際、その噴出口頭部3の封印膜3aを貫通するよう設けられ、炭酸ガス供給用ポンベからの噴出ガスを噴出用管11、内孔12、ノズル孔13に亘ってガス流通路を形成するノズル部10と、

(c) ノズル部10とソケット部5とを収納すると共に、且つ該ソケット部に捻じ込まれた炭酸ガス供給用ポンベの下端が一定長さ食み出す様、ポンベの上端噴出口頭部3を隠蔽してソケット部5のネジ孔6に炭酸ガスポンベの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4が捻じ込まれた状態で装填される下開口の上側筒体1であって、

炭酸ガス供給用ポンベBの下部の食み出し部Baは、前記捻じ込みおよび前記取替えのために保持されて回転できる様、上側筒体1の下端開口縁から下方へ一定長さ食み出し、下開口である上側筒体1と、

(d) 上側筒体1の上部面1bに、一方向および反対方向に水平回転する様、装着され

10

20

た円形調整用摘子 17 と、

(e) 円形調整用摘子 17 に垂下装備され、その下端 18 a がバネ 19 にて弁杆 15 の上端 15 a を弾圧する押圧杆 18 と、

(f) ノズル部 10 の内孔 12 に上昇、下降変位自在に設けられる弁杆 15 であって、弁杆 15 の上端 15 a は、押圧杆 18 の下端 18 a に当接し、弁杆 15 の下部は、

下降時には内孔 12 からノズル孔 13 へのガス流通路を遮断し、

上昇時には内孔 12 からノズル孔 13 へのガス流通路を形成する弁杆 15 と、

(g) 円形調整用摘子 17 の前記一方向への水平回転によって、押圧杆 18 を連動下降させて弁杆 15 の下部が前記ガス流通路を遮断し、円形調整用摘子 17 の前記反対方向への水平回転によって、該押圧杆 18 を連動上昇させて弁杆 15 の下部が前記ガス流通路を形成する手段と、

(h) 前記食み出し部 B a を挿入収納し、上側筒体 1 の下端開口縁と着脱自在に嵌合する上開口であり、而も底部が着座し、上側筒体 1 と共に直立型ポンベ収納ボックス X を構成する下側筒体 2 とを有し、

(i) 可撓性ホース P は、スプレー本体 S とノズル孔 13 とを接続することを特徴とする美顔器。

【請求項 2】

ポンベ収納ボックスの下側筒体を有底で、而も下広状のスカート状に形成したことを特徴とした請求項 1 記載の美顔器。

【請求項 3】

ポンベ収納ボックスの側面にスプレー本体を着脱自在に差込引掛ける引掛部を設けたことを特徴とした請求項 1 記載の美顔器。

【請求項 4】

引掛部を、スプレー本体が差込まれるホルダー部及び上側筒体の上部で、而も調整用摘子の直下に巻付くリング部とを金属板にて一体的に形成したフック体としたことを特徴とした請求項 3 記載の美顔器。

【請求項 5】

引掛部を、スプレー本体が差込まれるホルダー部及び上側筒体と下側筒体との夫々の嵌合する開口縁間に介在するリング部とを断面丸型金属体にて一体的に形成したフック体としたことを特徴とした請求項 3 記載の美顔器。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は化粧水と炭酸ガスとの混合液を顔肌等に噴霧状に吹き付ける美顔器に関する。

【背景技術】

【0002】

近時、遊離炭酸を含有する炭酸泉に入浴すると、炭酸泉内の炭酸成分が皮膚下の毛細血管に作用してこの毛細血管を拡張させ、これにより入浴者の血行が改善されて入浴者の疲労回復や健康増進が図れることは、既に広く知られている。

そこで、この炭酸成分が皮膚下の毛細血管に作用してこの毛細血管を拡張させる効果を利用して、化粧水と共に混合液を顔肌等に吹き付けると共に、皮脂や汚れ等の残骸物を顔肌から遊離させて取り除き、より若々しく美しい顔肌を指向する。

一般的な美顔器として、例えば下記技術文献 1 及び 2 が存在する。

これらは、単にスチーム噴射、更には顔肌に吸引パットを添わせて顔肌の残骸物をハード的に除去させるものであり、顔肌へのソフト的な癒しは考慮されておらず、却って顔肌等を傷めることも否定できなかった。

更に技術文献 3 が存在するが、これは単に炭酸ガス供給用ポンベをスプレー本体に直接取付け、即ち一体化したものに過ぎない。

特に、この技術文献 3 を含め他の文献についても炭酸ガス供給用ポンベが露呈しており

10

20

30

40

50

、使用者にとっては炭酸ガスを充満したポンベと言うことから違和感、不安感を抱き、敬遠される傾向にある。

技術文献 4 は炭酸ガスと化粧水との混合液をポンベに充満した所謂、エアゾールに過ぎない。

【 0 0 0 3 】

そこでこれらの多くの技術文献の下、本願発明者が発明者の一翼を担って技術文献 5 に示す如く、美顔器の製品化に結び付く発明が成された。

その後、本願発明者が更なる技術開発に傾注し、より実用に即した製品の具現化を探索することとした。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 4 】

本発明は、炭酸混合化粧水を生成する炭酸ガス供給用ポンベが使用時において直接目に触れない様にし、不必要な違和感、不安感を払拭し、且つポンベからの炭酸ガス噴出調整もポンベを直視することなく軽快に操作できることとした。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 5 】

本発明の美顔器は、上記課題を解決するために、所定量の化粧水をカップ 2 9 に収納し、且つ炭酸ガス供給用ポンベ B から可撓性ホース P を介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体 S の先端噴出ノズル 3 1 から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に、炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に於いて、

(a) ソケット部 5 のネジ孔 6 に炭酸ガス供給用ポンベ B の上端噴出口頭部 3 に形成されたネジ 4 が、炭酸ガス供給用ポンベ B を取替え可能に、捻じ込まれるソケット部 5 と

(b) 炭酸ガス供給用ポンベ B の上端噴出口頭部 3 の上部に対峙するようにソケット部 5 に設けられ、噴出用管 1 1、内孔 1 2、ノズル孔 1 3 を備えるノズル部 1 0 であって、噴出用管 1 1 は炭酸ガス供給用ポンベ B をソケット部 5 に捻じ込んだ際、その噴出口頭部 3 の封印膜 3 a を貫通するよう設けられ、炭酸ガス供給用ポンベからの噴出ガスを噴出用管 1 1、内孔 1 2、ノズル孔 1 3 に亘ってガス流路を形成するノズル部 1 0 と、

(c) ノズル部 1 0 とソケット部 5 とを収納すると共に、且つ該ソケット部に捻じ込まれた炭酸ガス供給用ポンベの下端が一定長さ食み出す様、ポンベの上端噴出口頭部 3 を隠蔽してソケット部 5 のネジ孔 6 に炭酸ガスポンベの上端噴出口頭部 3 に形成されたネジ 4 が捻じ込まれた状態で装填される下開口の上側筒体 1 であって、

炭酸ガス供給用ポンベ B の下部の食み出し部 B a は、前記捻じ込みおよび前記取替えのために保持されて回転できる様、上側筒体 1 の下端開口縁から下方へ一定長さ食み出し、下開口である上側筒体 1 と、

(d) 上側筒体 1 の上部面 1 b に、一方向および反対方向に水平回転する様、装着された円形調整用摘子 1 7 と、

(e) 円形調整用摘子 1 7 に垂下装備され、その下端 1 8 a がバネ 1 9 にて弁杆 1 5 の上端 1 5 a を弾圧する押圧杆 1 8 と、

(f) ノズル部 1 0 の内孔 1 2 に上昇、下降変位自在に設けられる弁杆 1 5 であって、弁杆 1 5 の上端 1 5 a は、押圧杆 1 8 の下端 1 8 a に当接し、弁杆 1 5 の下部は、

下降時には内孔 1 2 からノズル孔 1 3 へのガス流路を遮断し、

上昇時には内孔 1 2 からノズル孔 1 3 へのガス流路を形成する弁杆 1 5 と、

(g) 円形調整用摘子 1 7 の前記一方向への水平回転によって、押圧杆 1 8 を連動下降させて弁杆 1 5 の下部が前記ガス流路を遮断し、円形調整用摘子 1 7 の前記反対方向への水平回転によって、該押圧杆 1 8 を連動上昇させて弁杆 1 5 の下部が前記ガス流路を形成する手段と、

(h) 前記食み出し部 B a を挿入収納し、上側筒体 1 の下端開口縁と着脱自在に嵌合する上開口であり、而も底部が着座し、上側筒体 1 と共に直立型ポンベ収納ボックス X を構

10

20

30

40

50

成する下側筒体 2 とを有し、

(i) 可撓性ホース P は、スプレー本体 S とノズル孔 1 3 とを接続することを特徴とするものである。

【 0 0 0 6 】

更に本発明は、ポンベ収納ボックスの下側筒体を有底で、而も下広状のスカート形に形成したことを特徴とするものである。

【 0 0 0 7 】

ポンベ収納ボックスの側面にスプレー本体を着脱自在に差込引掛ける引掛部を設けたことを特徴とするものである。

【 0 0 0 8 】

更に本発明は引掛部を、スプレー本体が差込まれるホルダー部及び上側筒体の上部で、而も調整用摘子の直下に巻付くリング部とを金属板にて一体的に形成したフック体としたことを特徴とするものである。

【 0 0 0 9 】

また、本発明は引掛部を、スプレー本体が差込まれるホルダー部及び上側筒体と下側筒体との夫々の嵌合する開口縁間に介在するリング部とを断面丸型金属体にて一体的に形成したフック体としたことを特徴とするものである。

【 発明の効果 】

【 0 0 1 2 】

(1) 請求項 1 により、上側筒体にて炭酸ガス供給用ポンペの上端の噴出口頭部は隠蔽されて外部に触れることなく、その上部の円形調整用摘子の水平回転によりガス噴出を調整できる。

また、炭酸ガス供給用ポンペの下部は上側筒体の下端開口縁より一部が食み出しており、この食出し部をポンペの取替時、工具等で保持すると共に回転操作させてポンペの取替えを行うことができる。

勿論、その食出し部は上側筒体を下側筒体に嵌合させることにより該下側筒体に収納されているので外部に触れることはない。

更にこの下側筒体は底部が着座することで上側筒体とで直立型ポンベ収納ボックスを構成され、美顔器としてより感性を高めることができる。

また、炭酸混合化粧水を生成する炭酸ガス供給用ポンペが使用時において直接目に触れないのは勿論、ポンペからの炭酸ガス噴出調整もポンペを直視することなく直立型ポンベ収納ボックスの上部に装備された円形調整用摘子を水平回転させることにより、炭酸ガスの噴出、停止、更には噴出調整が軽快に行える。

さらに、炭酸ガス供給用ポンペの装填は、単に上側筒体のソケット部に捻じ込めば、ソケット部に備えられた噴出用信管がポンペの封印膜に貫通し、ガスはノズル部に亘って流通可能となり、また新規なポンペと取替える際は、逆にポンペを回転させてソケット部から簡単に外すことができる。

【 0 0 1 3 】

(2) 請求項 2 により、下側筒体は有底のため、炭酸ガス供給用ポンペは全体が隠蔽される。

また、下側筒体は下広状のスカート状に形成されているので、より安定して直立できる。

【 0 0 1 4 】

(3) 請求項 3 により、ポンベ収納ボックスの側面にスプレー本体を引掛装着して一体化することにより、無造作にスプレー本体が放置されず、ガス供給用ホース、ノズル部等への異常な外力が加わることを防ぎ、常に正常に使用できる。

【 0 0 1 5 】

(4) 請求項 4 により、スプレー本体を引掛けるフック体を金属板にて一体的に形成してそのリング部を上側筒体に巻付けたから、下側筒体と一体的に合成樹脂にて成型する場合、複雑な金型となるが、それらに比し安価である。

10

20

30

40

50

【0016】

(5) 請求項5により、フック体は断面丸型金属体（パイプ、丸棒）にて形成されているから、スプレー本体の着脱時に傷が付かず、また使用者に対しても同様であり、且つフック体は上下側筒体の開口縁間にて挟持され、特殊な手段を要しない。

【0017】

(6) 請求項6により、炭酸混合化粧水を生成する炭酸ガス供給用ポンペが使用時において直接目に触れないのは勿論、ポンペからの炭酸ガス噴出調整もポンペを直視することなく直立型ポンペ収納ボックスの上部に装備された円形調整用摘子を水平回転させることにより、炭酸ガスの噴出、停止、更には噴出調整が軽快に行える。

【発明を実施するための最良の形態】

10

【0019】

以下本発明を実施形態の図面に基づいて説明する。図1は美顔器の使用状態を示す斜視図であって、使用者が手先Hにてスプレー本体Sの握手部Saを保持している。図2は、美顔器全体を示す斜視図であって、下広状のスカート状に形成した直立型ポンペ収納ボックスXを上下側筒体1、2にて構成しており、スプレー本体Sがポンペ収納ボックスXの側面Xaに着脱自在に装着されている。更に図3、4は、上側筒体1に装填された炭酸ガス供給用ポンペBの食出し部Baを下側筒体2に収納した状態を示している。

【0020】

而して、具体的には炭酸ガス供給用ポンペBの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4を上側筒体1のソケット部5のネジ孔6に捻じ込む。

20

このソケット部5は上側筒体1の内筒7に装備されており、内筒7は上側筒体1の下開口1aより挿入されて両者1、7の抜止段部8、9にて圧入装備され、一体化される。

従って、炭酸ガス供給用ポンペBの上端噴出口頭部3は隠蔽されて外部に触れない状態で、該炭酸ガス供給用ポンペBが炭酸ガス供給用ポンペBの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4を上側筒体1のソケット部5のネジ孔6に捻じ込んで装填される。

ソケット部5のネジ孔6には炭酸ガス供給用ポンペBの上端噴出口頭部3の上部に対峙してノズル部10が螺着されている。

【0021】

このノズル部10は、図4、5に示す如く、噴出用管11を備えており、この噴出用管11が炭酸ガス供給用ポンペBを捻じ込んだ際、その噴出口頭部3の封印膜3aに貫通し、炭酸ガス供給用ポンペからの噴出ガスを噴出用管11、内孔12、ノズル孔13に亘ってガス流通路を形成する。

30

またノズル部10の底部には噴出口頭部3の封印膜3aに圧着してガス漏れ防止パッキン14が備えられている。

ノズル部10の内孔12には上下動する弁杆15を挿通しており、常にバネ16にて上方向に弾圧されている。而して、図5、6に示す如く、この弁杆15の上下動によってノズル孔13の開閉を行う。

【0022】

上側筒体1の上部面1bには炭酸ガス噴出調整用の円形調整用摘子17が位置しており、該円形調整用摘子17の内側面17bからは押圧杆18が垂下しており、その下端18aがバネ19にて弁杆15の上端15aに弾圧しており、且つそのバネ力は弁杆15のバネ16の力より勝っている。

40

即ち弁杆15は下方の噴出用管11の側にバネ16に抗して弾圧されている。

而して、押圧杆18と共に円形調整用摘子17も常に下方向に引張られている。

【0023】

円形調整用摘子17の内側面17bと上側筒体1の上部面1bとは夫々互に嵌合するラチェット20、21が設けてあり、円形調整用摘子17の一方向の回転、即ち時計方向の回転に対しては一定回転数にて緊締し、且つこれと反対方向、即ち反時計方向での、一定回転数以降両ラチェット20、21が空転することとしている。

具体的には、円形調整用摘子17の内側面17bにはボス22を設けており、その外周

50

に数条の凸状スパイラル 2 3 が形成されている。また、上側筒体 1 の上部面 1 b にはこれに噛合する凹状スパイラル 2 4 が形成されていて、円形調整用摘子 1 7 の一定以上の回転により凸状スパイラル 2 3 が上側筒体 1 の凹状スパイラル 2 4 から遊離することとなり、且つその状態から反対方向に回転させることによって、再度噛合することとなる。

【 0 0 2 4 】

図 3 に示す如く、炭酸ガス供給用ポンベ B は食出し部 B a を下側筒体 2 に収納されており、その下側筒体 2 は有底としているので上開口 2 a より挿入された炭酸ガス供給用ポンベ B は底部 2 b にて覆われる。

また、下側筒体 2 は下広状のスカート状面 2 c となっているから、より安定して直立できる。

図 7 はスプレー本体 S をポンベ収納ボックス X の側面 X a の側面に着脱自在に引掛ける差込引掛部 Z の具体例を示し、握手部 S a が差込まれるホルダー部 2 5 a 及び上側筒体 1 の上部で、而も調整用摘子 1 7 の直下の溝 2 6 に巻付くリング部 2 5 b とを金属板にて一体的に形成したフック体 2 5 としている。

勿論、図 8 に示す如く、フック体 2 5 を断面丸型金属体にて一体的に形成し、上側筒体 1 の下開口 1 a と下側筒体 2 の上開口 2 a との間にて挟着しいもよい。

【 0 0 2 5 】

而して図 9 は、スプレー本体 S の具体例を示し、握手部 S a と直行する筒部 2 7 を内蔵配置している。この筒部 2 7 は導管 2 8 を主として成している。

導管 2 8 の前方位置には所定量の化粧水 W を収納するカップ 2 9 を導管 2 8 の内孔 2 8 a に連通したネジ孔 2 8 b に着脱自在にねじ込み取付装備している。この化粧水 W としては、例えば一般化粧剤にゲルマニウム粒子を混合させれば、炭酸成分の保湿性と美白効果が一層強まり、美容目的、即ちソフト的効能が一層好適となる。

【 0 0 2 6 】

このカップ 2 9 は導管 2 8 にねじ込まれる下端の滴下口 2 9 a とより成っている。また、導管 2 8 の先端には噴出ノズル 3 1 が設けられている。スプレー本体 S の導管 2 8 から握手部 S a を通った可撓性ホース P がノズル部 1 0 のノズル孔 1 3 に接続されている。勿論、この可撓性ホース P は必要に応じた長さで設定する。

また、この握手部 S a には操作部 3 0 が装備されており、この操作部 3 0 を操作することにより、導管 2 8 の内孔 2 8 a を開閉するシャッター板 3 2 を上下にスライドさせる。

【 0 0 2 7 】

具体的には、操作部 3 0 を反転レバー形式として、軸 3 3 にて反転自在に支持し、リンク 3 4 の一方ピン 3 4 a を操作部 3 0 に軸結合し、他方ピン 3 4 b をシャッター板 3 2 のリング 3 5 に軸結合している。

勿論、この操作部 3 0 を押ボタン形式にすることも可能である。

操作部 3 0 には、常に操作部 3 0 を矢印 c、シャッター板 3 2 を矢印 d と反対方向にバネ力を付勢している。

【 0 0 2 8 】

このシャッター板 3 2 は、化粧水収納カップ 2 9 と炭酸ガス供給用パイプ P の引込口 3 6 との間に位置し、操作部 3 0 の引き付けによりリンク 3 4、3 5 を介して縦溝 3 7 を下方方向にスライドし、シャッター板 3 2 の小孔 3 2 a と導管 2 8 の内孔 2 8 a とが合致し炭酸ガスの流入を可能とする。

導管 2 8 の内孔 2 8 a には、化粧水収納カップ 2 9 の滴下口 2 9 a に逆止弁 3 8 が装備されており、炭酸ガスが化粧水収納カップ 2 9 側に流入するのを防止し、適正な炭酸成分の混合化粧水が得られる。この逆止弁 3 8 としては薄膜の合成樹脂にて成型する。

【 0 0 2 9 】

また、導管 2 8 の先端噴出ノズル 3 1 はパッキン 3 9 を介在してカップリング 4 0 を螺着してシールドする。

更に、噴出ノズル 3 1 には顔肌に添わせる吸引パット 4 1 を適宜装着する。

勿論、この吸引パット 4 1 を使用せずして直接肌面に噴霧混合化粧水を吹き付けてもよ

10

20

30

40

50

い。

【使用動作説明】

【0030】

次に本発明美顔器の使用順序を説明すると、スプレー本体Sの使用動作は先の本願発明者が発明者の一翼を担った技術文献5に示す内容とほぼ同内容であり、従って、炭酸ガス供給用ポンベBの装填、取替え及び炭酸ガス噴出の調整について説明する。

図4は炭酸ガス供給用ポンベBが装填された状態を示している。この状態は、炭酸ガス供給用ポンベBの噴出口頭部3が上側筒体1のソケット部5に捻じ込まれており、ソケット部5の噴出用管11が炭酸ガス供給用ポンベBの封印膜3aを貫通している。

【0031】

而してノズル部10の弁杆15は下方向に下降しており、内孔12とノズル孔13との間は遮断されている。

従って、この状態に於いてスプレー本体Sを操作しても、炭酸ガスが噴出供給されていないからスプレー本体Sから炭酸混合化粧水は霧状に噴出することはない。

勿論、この状態は円形調整用摘子17が時計方向に回転しており、円形調整用摘子17の凸状スパイラル23が上側筒体1の凹状スパイラル24に噛合緊締し、且つ円形調整用摘子17の押圧杆18は下降し、その状態は維持されているから、図5に示す如くバネ16に抗して弁杆15を下方向に弾圧下降状態に維持されており、ガス漏れはない。

【0032】

続いて、スプレー本体Sを使用し、炭酸混合化粧水を霧状に噴出するに当たっては、上記状態より円形調整用摘子17を反時計方向に回転させる。

円形調整用摘子17の一定以上に回転すると、円形調整用摘子17の凸状スパイラル23が上側筒体1の凹状スパイラル24より遊離し、以降両ラチェット20、21が空転する。

而して、図6の夫々の矢印に示す如く円形調整用摘子17の押圧杆18はバネ19に抗して上昇する。この押圧杆18の弾圧開放により弁杆15はバネ16にて上昇して、維持される。

【0033】

弁杆15の上昇にて、噴出用管11、内孔12、ノズル部10のノズル孔13に亘ってガス流通路を形成される。

この状態に於いて、スプレー本体Sを操作すれば、炭酸ガスと化粧水収納カップ29からの炭酸ガスとが混合し、所望の炭酸混合化粧水をスプレー本体Sの噴出ノズル31から霧状に噴出させることとなる。

【0034】

次にスプレー本体Sからの炭酸混合化粧水の噴出を停止、即ちスプレー本体Sの使用を終了する場合は、円形調整用摘子17を時計方向に回転し、円形調整用摘子17の凸状スパイラル23を上側筒体1の凹状スパイラル24に噛合緊締させると共に押圧杆18を下降させる。

これにより図5に示す如くバネ15に抗して弁杆15は下方向に弾圧下降し、ノズル部10のノズル孔13と噴出用管11とのガス流路を遮断し、ガス供給は断たれる。

勿論、この状態でこの状態に於いてスプレー本体Sを操作してもスプレー本体Sからは炭酸混合化粧水が噴出することはない。

尚、ガス消耗による炭酸ガス供給用ポンベBの取替えは、先ず炭酸ガス供給用ポンベBの食出し部Baを保持して回転させ、ソケット部5から取り外す。

【0035】

次にガス充満の炭酸ガス供給用ポンベBを装填する場合は、炭酸ガス供給用ポンベBの上端噴出口頭部3を上側筒体1のソケット部5に捻じ込む。

而してソケット部5の噴出用管11が噴出口頭部3の封印膜3aに貫通し、炭酸ガス供給用ポンベBからの噴出ガスは噴出用管11、内孔12、ノズル孔13に亘ってガス流通路を形成し、炭酸ガス供給用ポンベBの装填を完了することとなる。

10

20

30

40

50

【産業上の利用可能性】

【0036】

本発明は美顔器としているが、勿論他の腕、足、身体の肌面への炭酸混合化粧水を噴射することも出来るのである。

【図面の簡単な説明】

【0037】

【図1】美顔器の使用状態を示す斜視図

【図2】美顔器の全体斜視図

【図3】美顔器の一部断面図

【図4】同上の部分拡大断面図

10

【図5】同上の拡大部分断面図

【図6】同上の動作状態を示す拡大部分断面図

【図7】美顔器の部分斜視図

【図8】同上の異なる実施形態を示す部分斜視図

【図9】スプレー本体の断面図

【図10】同上の部分拡大断面図

【図11】同上の動作状態を示す拡大部分断面図

【図12】同上の部品の分解斜視図

[符号の説明] H...使用者の手先、B...炭酸ガス供給用ポンベ、B a...ポンベ食出し部、X...収納ボックス、S...スプレー本体、P...可撓性ホース、1...上側筒体、2...下側筒体、3...噴出口頭部、5...ソケット部、10...ノズル部、11...噴出用管、12...内孔、13...ノズル孔、15...弁杆、17...円形調整用摘子、18...押圧杆、20...ラチェット、21...ラチェット、23...凸状スパイラル、24...凹状スパイラル Z...引掛部、28...導管、29...カップ、31...噴出ノズル

20

【符号の説明】

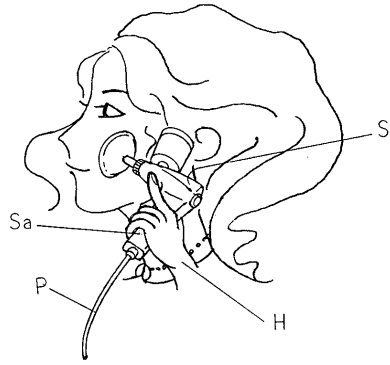
H 使用者の手先
 B 炭酸ガス供給用ポンベ
 B a ポンベ食出し部
 X 収納ボックス
 S スプレー本体
 P 可撓性ホース
 1 上側筒体
 2 下側筒体
 3 噴出口頭部
 5 ソケット部
 10 ノズル部
 11 噴出用信管
 12 内孔
 13 ノズル孔
 15 弁杆
 17 円形調整用摘子
 18 押圧杆
 20 ラチェット
 21 ラチェット
 23 凸状スパイラル
 24 凹状スパイラル
 Z 引掛部
 28 導管
 29 カップ
 31 噴出ノズル

30

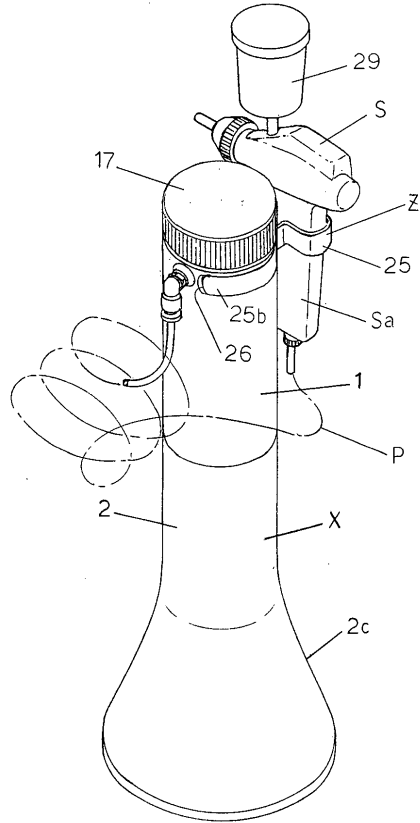
40

50

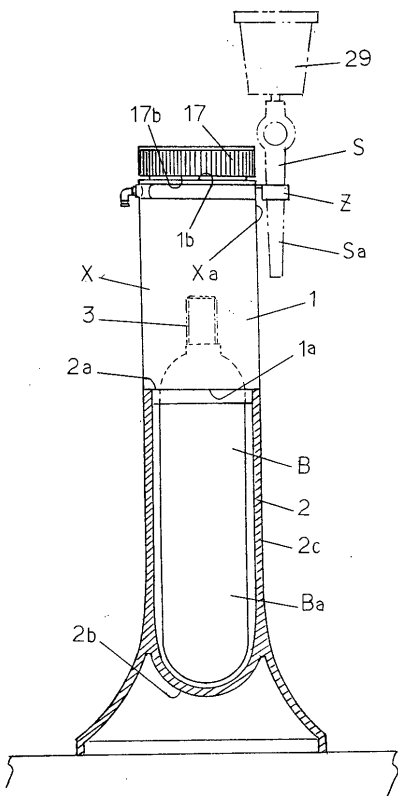
【図1】



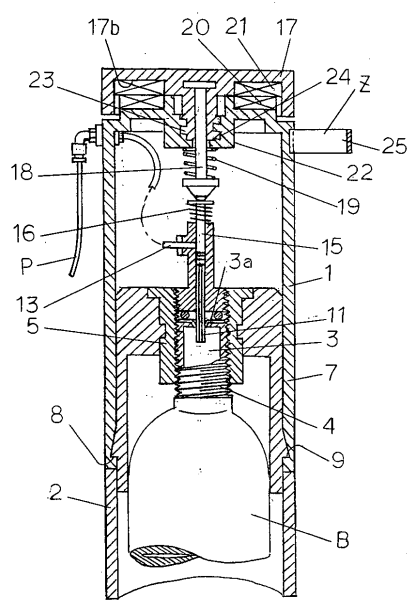
【図2】



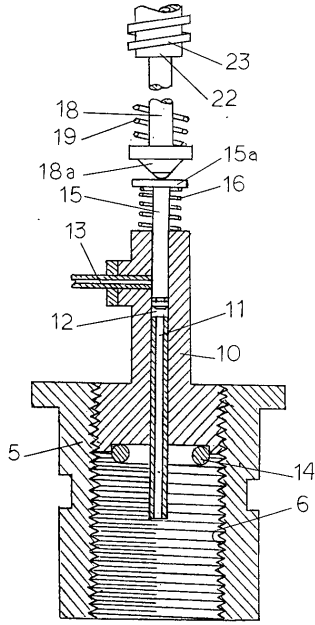
【図3】



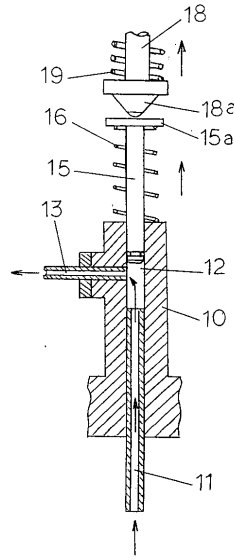
【図4】



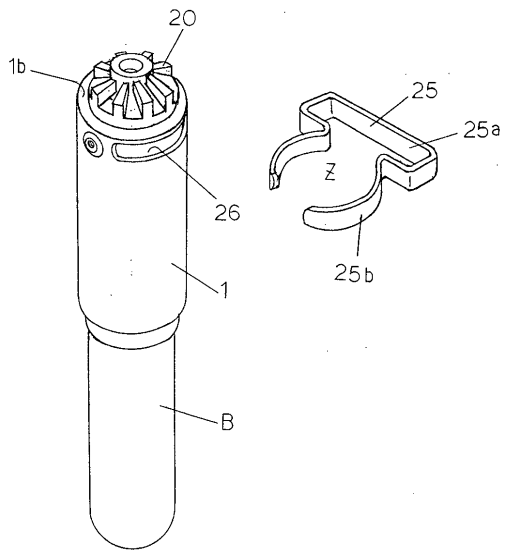
【図5】



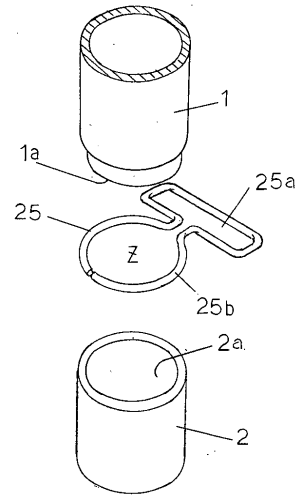
【図6】



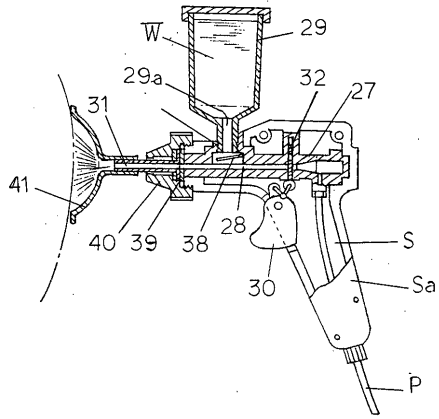
【図7】



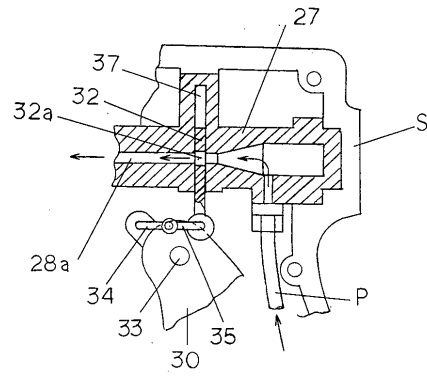
【図8】



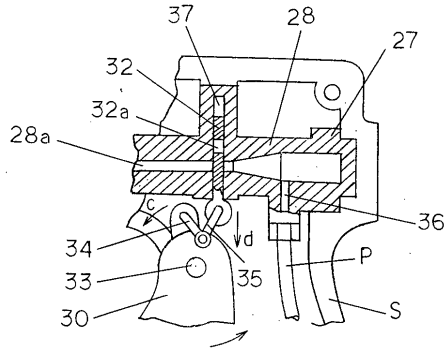
【図9】



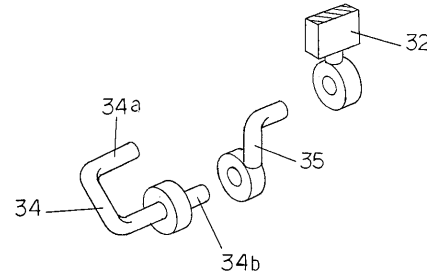
【図11】



【図10】



【図12】



フロントページの続き

(56)参考文献 登録実用新案第3136465(JP,U)

実公平01-033977(JP,Y2)

実公平03-038563(JP,Y2)

特開昭62-235098(JP,A)

特開平07-031636(JP,A)

特開平05-231597(JP,A)

特開昭62-226208(JP,A)

特開2005-249193(JP,A)

特許第3558064(JP,B2)

特開2008-180333(JP,A)

特開平03-168571(JP,A)

実公平07-040847(JP,Y2)

特開2003-322300(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.,DB名)

A61H 33/12

A61H 33/02